

総合イベント「マイクロナノ2009」 同時開催プログラム

マイクロナノ第六十八号
平成二十一年七月二十一日発行
平成二十一年七月十七日印刷
印刷所
タカラ印刷紙工業株式会社

第15回国際マイクロマシン・ナノテクシンポジウム - MEMS World - プログラム 「集積化・融合化の進むMEMS/ナノデバイス 産業化のブレークスルー」- 研究開発拠点の集約化とMEMSアプリケーション -	
主催:(財)マイクロマシンセンター MEMS協議会 司会:(独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス製造研究部門 上席研究員 前田龍太郎	
オープニング	
10:30 - 10:35	開催挨拶 (財)マイクロマシンセンター 理事長 野間口 有
10:35 - 10:40	来賓挨拶 経済産業省 製造産業局 産業機械課長 米村 猛
基調講演 最先端研究所へのMEMS研究開発の集約化	
10:40 - 11:10	フランスにおけるMEMS Leti / MINATECのR&Dモデルとビジョン CEA-LETI, MINATEC Silicon Heterogenous Integration Dept. Andre Rouzaud
11:10 - 11:40	マイクロ・ナノへ向かう統合システム技術 Head of Fraunhofer ENAS(Research Institution for Electronic Nano Systems) Prof. Thomas Gessner
11:40 - 12:10	世界におけるMEMSの成長機会; MIGの展望 米国におけるMEMSの動きと新技術 MEMS Industry Group Managing Director, Karen Lightman
セッション1 MEMSが拓く新しい世界(アプリケーション)	
13:10 - 13:40	安全・安心のためのアニマルウォッチセンサの開発 (独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 ネットワークMEMS研究 グループ長 伊藤 寿浩
13:40 - 14:10	シリコン光変調器の実現技術 Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems, Thilo Sandner
14:10 - 14:40	安全・安心・健康を目指したウェアラブルエレクトロニクス 東京理科大学・総合科学技術経営研究科 教授 NPO ウェアラブル環境情報ネット推進機構理事長 坂生 清
14:40 - 15:10	苛酷環境対応ワイヤレスMEMSセンサー:エネルギーと発電への応用 UC Berkeley, BSAC Department of Mechanical Engineering, Prof. and Chair Albert P. Pisano
セッション2 開発現場のニーズに応える最新プロセス・材料技術動向	
15:20 - 15:45	SOIはMEMSにおける制約を打破できるか? ウェハバンダーからの提案 Okmetic Oyj Senior Vice President, Research, Markku Tili
15:45 - 16:10	Chip to Wafer接合の最新技術と今後の展望 EVGroup Director of Technology, Technology Div., Sunil Wickramanayaka
16:10 - 16:35	MEMS向けハーメチック実装設計;現状と今後の展望 SAES Getters S.p.A. Business Manager, Getter for MEMS, Marco Moraja
クロージング	
16:35 - 16:45	閉会挨拶 (財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一
MEMS実装・パッケージングフォーラム	
主催:(財)マイクロマシンセンター MEMS協議会 / 溶接学会 マイクロ接合研究会 (財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一	
13:00 - 13:10	開会の挨拶 立命館大学 立命館グローバル・イノベーション研究機構 教授 杉山 進
13:10 - 13:50	MEMSの集積・融合の進展と新産業創出への期待 大阪大学大学院 工学研究科 マテリアル生産科学専攻 教授 藤本 公三
13:50 - 14:30	電子デバイス実装の展開と今後の動向 パナソニック電工(株) 微細プロセス開発センター センター長 久保 雅男
14:30 - 14:50	ウェアレバブルパッケージングによる機能集積MEMSの創出 オリンパス(株)研究開発センター 精密技術開発本部 MEMS開発部長 太田 亮
14:50 - 15:10	異種材料多層MEMS集積化技術開発 榑東芝 生産技術センター 実装技術研究センター 小畑 進
15:10 - 15:30	In-Line WLP(Wafer Level Package)技術を用いた低コストRF-MEMS/リアリカルパビタの開発 大阪大学大学院 工学研究科マテリアル生産科学専攻 助教 西山 宏昭
15:30 - 15:50	非線形リングラフィを用いた立体基板上へのパターンング技術
日独マイクロナノ・ビジネスフォーラム	
主催:IVAMマイクロテクノロジーネットワーク 共催:(財)マイクロマシンセンター MEMS協議会	
【開催時間】10:30 - 14:15	
【プログラム】ドイツNRW(ノルトライン・ヴェストファーレン)州に拠点を置く「IVAMマイクロテクノロジーネットワーク」の主催により、ヨーロッパを中心としたIVAM会員企業の技術・製品をご紹介しますとともに、IVAM会員企業と日本の企業とのビジネスマッチングの機会を提供いたします。	
BEANSプロジェクトセミナー	
主催:(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 / 技術研究組合BEANS研究所 司会:技術研究組合BEANS研究所 副所長 竹井 裕	
13:10 - 13:15	主催者挨拶 (独)新エネルギー・産業技術総合開発機構 理事 上原 崇
13:15 - 13:25	プロジェクトリーダー挨拶 技術研究組合BEANS研究所 所長(BEANS プロジェクトリーダー) 遊佐 厚
13:25 - 13:55	MEMSの展望とBEANSプロジェクトへの期待 東北大学 教授 江刺 正喜
13:55 - 14:25	MEMS市場・技術最新動向 日経マイクロデバイス 副編集長 三宅 常之
14:25 - 14:55	BEANSプロジェクトの構想と意義 東京大学 教授(BEANS プロジェクト サブプロジェクトリーダー) 藤田 博之
14:55 - 15:15	ハイドロゲルビーズで包む、埋め込む、組み立てる 東京大学 准教授(Life BEANSセンター長) 竹内 昌治
15:15 - 15:35	有機ナノ構造体の創製 - 有機半導体の飛躍的な性能向上を目指して - 九州大学 教授(Life BEANS九州センター長) 安達千波矢
15:35 - 15:55	ナノギャップを埋める超臨界膜技術 東京大学 准教授(3D BEANSセンター長) 杉山 正和
15:55 - 16:15	超低損傷・中性粒子ビームエッチング技術 東北大学 教授 寒川 誠二
16:15 - 16:35	マイクロ・ナノ加工技術の宇宙用赤外センサへの応用 立命館大学 教授(BEANS プロジェクト サブプロジェクトリーダー) 木股 雅章
16:35 - 16:55	Macro-BEANSのメーター級大面積高機能デバイス実装化戦略 産業技術総合研究所 ネットワークMEMS研究グループ長(Macro BEANSセンター長) 伊藤 寿浩
16:55 - 17:00	閉会挨拶 (財)マイクロマシンセンター 専務理事 青柳 桂一
マイクロナノ2009 MEMS協議会(MIF)フォーラム MEMS産業の発展と裾野拡大に向けて:MEMS協議会からの情報発信	
主催:(財)マイクロマシンセンター MEMS協議会 司会:(財)マイクロマシンセンター MEMS協議会 事務局次長 片白 雅浩	
オープニング	
10:30 - 10:35	開会挨拶 MEMS協議会 副会長 オムロン(株)執行役員常務 技術本部長 今仲 行一
10:35 - 10:50	Introductory Talk:MEMS産業発展に今何が求められているか - 協議会活動の役割とその活動 - (財)マイクロマシンセンター 専務理事 MEMS協議会事務局次長 青柳 桂一
セッション1 拡大するMEMS産業をデータで見よう!	
10:50 - 11:10	国際会議に見るMEMS技術の動向と将来展望 早稲田大学理工学術院電子光システム学科ナノ理工学専攻 教授 庄子 習一
11:10 - 11:30	様々な業種が参入するMEMSプレーヤー(MEMS分野の産業動向調査報告) (財)マイクロマシンセンター 産業交流部長 阿出川俊一
11:30 - 11:50	MEMS国際標準化最新動向 - 高まる重要性和ビジネス活用 - 国際標準化工学研究所代表 帝京大学理工学部情報科学科 教授 大和田邦樹
11:50 - 12:10	このように使う:MEMS材料評価の国際標準規格 熊本大学大学院 自然科学研究科マテリアル工学専攻 教授 高島 和希
セッション2 国際競争に勝つ研究開発・製造インフラの充実	
13:05 - 13:25	ナノテクアーリーナを活用するMEMS版「知と経験の集積拠点」構想 (財)マイクロマシンセンター MEMS協議会 事務局次長 片白 雅浩
13:25 - 13:45	MEMSファンドリーネットワークシステムの拡充 MEMS協議会ファンドリーサービス産業委員会 委員長 オムロン(株)エレクトロニクスコンポーネンツカンパニー マイクロデバイス事業部MEMS開発部長 佐藤 文彦
13:45 - 14:05	MEMSの設計・製造工程における課題の検証ツール "MemsONE" (財)マイクロマシンセンター 普及促進部 担当部長 水津 美晴
14:05 - 14:25	リリースされたMEMS分野の百科事典 "MEMSPedia" (財)マイクロマシンセンター MEMSシステム開発センター長 小池 智之
14:25 - 14:45	マイクロナノ量産技術と応用デバイス製造に関する新事業開拓イノベーション人材育成 (独)産業技術総合研究所 先進製造プロセス研究部門 高橋 正春
14:45 - 15:15	韓国におけるMEMS産業化に向けたR&D状況 Korea Institute of Industrial Technology(KITECH) Senior Researcher, Sung Ho Lee, Ph.D
セッション3 MEMS産業・研究開発拠点の形成への期待	
15:15 - 15:35	東北地域におけるMEMS関連産業の取組み 「TOHOKUものづくりコリドー」統括コーディネータ / MEMS/パークコンソーシアム事務局長 竹井 裕
15:35 - 15:55	微細加工技術に関する九州地域の取組み (財)北九州産業学術推進機構 産学連携センター長 宮下 永
15:55 - 16:15	転写によるマイクロ・ナノ製造拠点 環境エネルギー分野への展開 兵庫県立大学 高度産業科学技術研究所 教授 服部 正
クロージング	
16:15 - 16:20	閉会挨拶 (財)マイクロマシンセンター 専務理事 MEMS協議会事務局次長 青柳 桂一
ファインMEMSプロジェクト成果発表会	
主催:(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構	
平成20年度に終了した「高集積・複合MEMS製造技術開発プロジェクト(ファインMEMSプロジェクト)」(平成18年度~平成20年度)の全研究開発成果として、4つの開発カテゴリー(MEMS / ナノ機能の複合、MEMS / 半導体の一体形成、MEMS / MEMSの高集積化、知識データベースの整備)と、ファインMEMSシステム化設計プラットフォームの開発の成果をご紹介します。プログラムは現在調整中	

発行

財団法人 マイクロマシンセンター

発行人 青柳 桂一
〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル6階
TEL.03-5835-1870 FAX.03-5835-1873
wwwホームページ: http://www.mmc.or.jp/

技術研究組合BEANS研究所

発行人 青柳 桂一
〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸67 MBR99ビル6階
TEL.03-5835-1870 FAX.03-5835-1873
wwwホームページ: http://www.beanspj.org/lab/

無断転載を禁じます。